

Eos200



Eos200 是 AVANT 公司最新推出的一款用于 GEM/SECS 的精密加工设备，于 2022 年 5 月正式投产。

- Eos200 的主要特点包括：
- 采用先进的工业级材料，确保设备的高精度和稳定性。
 - 支持多种材料加工，如 SiC、GaN、GaAs 等。
 - 具备完善的 SECS/GEM 接口，易于集成到现有的生产线上。
 - 提供多种规格选择，如 HSMS/SECS-1 等。

主要性能指标

FTIR 精度：±0.1%

加工材料：SiC、GaN、GaAs 等

主要规格

FROC 精度：±0.1%

加工材料：ZnSe、DTGS 等

加工精度：±0.1%

加工速度：1000 件/小时

加工精度	0.5 - 150 μm
(1 sigma)	< 0.005
(1 sigma)	< 0.01
加工速度	< 1mm

产量 (WPH)	> 230
90%	> 85

加工精度	5000 - 600 cm ⁻¹
加工速度	1 cm ⁻¹
加工材料	(1 - 4.5 mm)
加工温度	22°

加工精度	150 - 200mm
加工速度	2
加工材料	2 (6' / 8)

MTBF	> 2000 Hours
MTTR	≤ 4 Hours
MTBA	≥ 168 Hours
加工精度	> 98%
加工速度	≤ 48 Hours
加工材料	≤ 2 Hours